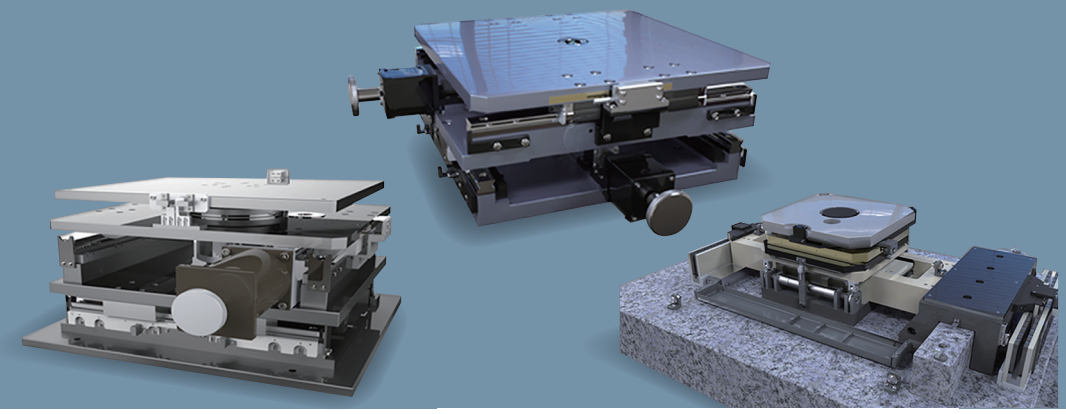
多自由度精密工件台系列

Multi-degree of Freedom of Precision Stage

定制



主要技术与性能指标

- 行程：0.1—1 m
- 定位精度：20—200 nm
- 速度：20—800 mm/s

主要应用

精密测量、光刻设备

代表性应用成果

- 投影光刻机
- 电子束光刻机
- 大面积光栅刻划机
- 半导体检测设备
- 其他检测仪器

主要用户单位	中国科学院电工研究所、长春光学精密机械与物理研究所、光电研究院、重庆绿色智能院、微电子研究所、广州生物医药与健康研究院，中国电子科技集团 48 所、41 所，以及电子科技大学、四川大学等
研制单位	中国科学院光电技术研究所
联系方式	赵立新　028-85101784，13568853630　zhaolixin@ioe.ac.cn